

VACUUM2015 - 真空展に出展

優れた製品パフォーマンスを実感できるデモンストレーションと稼働展示

キャノンアネルバ株式会社(社長：酒井純朗、本社：神奈川県川崎市麻生区栗木 2-5-1、以下：キャノンアネルバ)は、9月8日(火)～10日(木)の3日間、パシフィコ横浜にて開催される“VACUUM2015 - 真空展”に出展します。



キャパシタンスゲージ M-342DG

■〈近日発売〉成膜圧力制御に「キャパシタンスゲージ M-342DG 13.3Pa 仕様」

発売以来様々な産業分野で採用実績を増やしている、業界トップクラスのスペックを実現した隔膜真空計「キャパシタンスゲージ M-342DG」シリーズに、成膜プロセスの圧力制御に対応する13.3Pa 仕様が加わります。

弊社ブースでは発売済みのフルスケール 133Pa/1.33kPa/13.3kPa/133kPa の実機と共に、2016年初頭発売予定の13.3Pa 仕様のサンプル品を出展します。同シリーズのコンセプトである「高精度で安定した圧力測定」を、デモンストレーションを通じてご紹介します。

■ヘリウム漏れ検知器、新概念の冷凍トラップなどを稼働展示

シンプルな操作性と高い検知性能を両立し、世界中で多数の採用実績をもつヘリウム漏れ検知器「HELEN(ヘレン)シリーズ」が、各種構造の再検討を経てバージョンアップ。その他別置きコンプレッサユニットとヘリウム配管を廃した新概念の水分排気用冷凍トラップ「SCトラップ(仮称)」のプロトタイプなど、キャノンアネルバの技術が詰まった注目商品を稼働展示します。

■クライオポンプ、真空計などの主力製品の他、成膜装置、サービス事業をご紹介

優れた省エネルギー性能を有するクライオポンプ「POWER Eco シリーズ」の実機展示、及び省エネルギーを実現する制御方法をイメージ画像で紹介いたします。この他、真空計、真空ポンプなどの主力製品の実機展示に加え、真空成膜装置や部品の洗浄サービス、受託加工サービスをパネルでご紹介します。

■VACUUM2015-真空展

- ・会期： 2015年9月8日(火)～10日(木) (<http://www.nikkan.co.jp/eve/vacuum/>)
- ・会場： パシフィコ横浜 展示ホール B
- ・キャノンアネルバブース： V-116

- 報道関係者のお問い合わせ先：キャノンアネルバ株式会社 経営企画センター 044-980-5121
- その他のお問い合わせ先：同 フィールドソリューション事業部 FS 販売統括部 044-980-3503
- キャノンアネルバ ホームページ：<http://www.canon-anelva.co.jp/>

<主な展示品のご紹介>

1. 高精度で安定した圧力測定 隔膜真空計「キャパシタンスゲージ M-342DG」

- ・ 大気圧～低真空領域の高精度・絶対圧測定が可能な隔膜真空計。
- ・ 小型シリコン MEMS チップ製ダイヤフラムを採用。高精度で安定した圧力測定を実現。
- ・ ゼロ点調整頻度の最小化、および電源投入後短時間で使用可能など、使いやすさを追求。
- ・ 温度調整型と同等の測定性能。置き換えにより大幅なコストダウンが可能。
- ・ 低圧側に広い実用圧力測定範囲により測定圧力によってはゲージ総数の削減が可能。
- ・ 現行のトランスデューサ型真空計の専用表示器「M-601GC」「M-603GC」に適合。
- ・ フルスケール圧力 133Pa(1Torr)、1.33kPa(10Torr)、13.3kPa(100Torr)、133kPa(1000Torr)をラインナップ。2016年初頭に成膜圧力制御に対応する 13.3Pa(0.1Torr)を発売予定。



キャパシタンスゲージ M-342DG

2. 着脱式ハンドコントローラー付 ヘリウム漏れ検知器「HELEN (ヘレン)」

- ・ 本体から着脱可能な 4.1 インチカラー液晶パネル付ハンドコントローラーを標準装備。最大 8m まで伸びるコード付きで、使いやすさに優れ、大型装置などの漏れ試験にも対応。
- ・ 小型で可搬性に優れた M-212LD(-D)、大型粗引きポンプ (230~250L/min) を装備した M-222LD(-D)、スニファー法専用タイプの M-232LD、及び高感度仕様で RoHS 指令、CE マーキングに対応した M-222LD(-D)-H を展示予定。



ヘリウム漏れ検知機 M-222LD



着脱式ハンドコントローラー

3. 優れた省エネルギー性能 クライオポンプ「POWER Eco」シリーズ

- ・ 省エネルギーの観点から、消費電力や冷却水量を低減することを目的として開発された高性能省エネルギー型のクライオポンプ。
- ・ 実用性に優れたポンプの起動特性とマルチ運転時の温度安定性。
- ・ 自己発熱機能や独自の排気パネル構造により、ヒーター無しで高速再生が可能。



クライオポンプ POWER Eco シリーズ

4. コンプレッサが不要な冷凍トラップ「SCトラップ(仮称)」【2015年末発売予定】

- ・新開発スターリング冷凍機の採用により、別置コンプレッサユニットとヘリウム配管を廃し、圧倒的な省スペースと省エネルギーを実現したクライオトラップ。
- ・ターボ分子ポンプの直上に設置することで、圧倒的な水分の排気性能向上を実現。
- ・メンテナンスフリーで、ランニングコスト低減に貢献。



スターリング式冷凍トラップ SCトラップ(仮称)

5. 高感度「高圧動作プロセスガスモニタ(仮称)」【2015年末発売予定】

- ・通常の高感度型質量分析計は動作できない高い圧力での動作が可能。
- ・高感度、低バックグラウンドで、これまでは難しかった水素の検知も可能。
- ・長寿命フィラメントによりメンテナンスサイクルの長期化に貢献。



高圧動作プロセスガスモニタ(仮称)

6. 分析管・電源部一体型質量分析計「トランスデューサ型マスフィルタ」

- ・分析管と電源部が一体化したトランスデューサ型のため、電源据置き型と比較して省エネルギー、省配線、省スペース。装置への取付けも容易。
- ・ガス組成のモニタにより、システム不具合解析やプロセススタート条件の確認に貢献。
- ・操作も容易な専用ソフトウェア「QUADVISION」を標準添付（日本語版または英語版）



トランスデューサ型マスフィルタ

7. ガス分析装置のエントリーモデル「コンパクト型ガス分析システム Cシリーズ」

- ・分析管、コントローラー、排気系(ターボ分子ポンプ+粗引きポンプ)、ガス導入系をコンパクトで軽量のフレームに搭載し、「使いやすさ」を追求したガス分析システム。
- ・用途に応じて構成内容の選択が可能で、各種測定に対応可能。
- ・スイッチ一つで排気制御が可能。排気/測定用インターロック機能を搭載。
- ・フットプリント約 480mm×500mm で省スペース。
- ・真空計、ヒーターなどをオプションで設置可能（写真はPCを設置した状態）。



8. 大気圧～超高真空の測定が可能「トランスデューサ型真空計」シリーズ

- ・「クリスタルイオンゲージ」「コールドカソードピラニゲージ」「イオンゲージ」「キャパシタンスゲージ」「ピラニゲージ」の5機種をラインナップし、各種の測定圧力領域や用途に対応。
- ・電源部とセンサー部が一体化したトランスデューサ型のため、電源据置き型と比較して省エネルギー、省配線、省スペース。
- ・大型カラーLCDパネル付表示器「M-603GC」(別売)では真空計3台の同時モニタリングが可能。



クリスタルイオンゲージ M-336MX



3チャンネル表示器 M-603GC

9. Edwards 社製真空ポンプ

- ・加圧給油方式を採用し、大気圧から高真空までの運転がスムーズに行えるオイル逆流防止機構付きのロータリーポンプ「RV シリーズ」。
- ・性能、信頼性およびユーザーでの使いやすさを提供する最高レベルの理科学分野向けターボ分子ポンプ「nEXT シリーズ」。
- ・優れた排気速度と最高度の真空到達圧力を備え、クラス最高のパフォーマンスを提供するスクロールドライポンプ「nXDS シリーズ」。



ロータリーポンプ RV シリーズ



ターボ分子ポンプ nEXT シリーズ



スクロールドライポンプ nXDS シリーズ

10. その他の真空コンポーネント製品

- ・ 10^{-9} Pa 台の排気可能な超高真空ポンプ「イオンポンプ」
- ・海外使用可能な上位互換モデル「イオンポンプ用制御電源 P-500 シリーズ」
- ・バルブ、フランジ、導入機など超高真空対応の配管部品を多数展示

11. 真空装置・保守サービス

- ・真空機器の総合メーカーだから提供できる高品質「部品洗浄・再生サービス」
- ・納品後そのまま超高真空部品として使用可能「超高真空部品の受託加工サービス」
- ・多彩な蒸着に対応・実験用にカスタマイズ可能「高真空蒸着装置 EB1900」
- ・脱泡時の液切れ現象や注入後のワーク内の気泡を解消「バッチ式注入装置」
- ・封孔時間の大幅短縮、ロボットレス・反転機構レス「バッチ式封孔装置」
- ・電子部品の開発から生産まで、多様なニーズに対応「EB1100, EC7000 スパッタ装置」
- ・MEMS・高周波デバイスに必要な高均一性を実現する生産装置「EC7400 スパッタ装置」
- ・高輝度 LED の量産に貢献する「EL3000 スパッタ装置」
- ・SiC パワーデバイス活性化アニール工程に対応「EC7200 EBAS」
- ・高密度実装用大型プリント基板対応 PVD 装置「EL3400」

<キャノンアネルバについて>

キャノンアネルバはキャノングループの一員です。

当社は、真空・薄膜技術を基幹技術とした真空薄膜形成装置や真空コンポーネント製品を開発から製造、販売、保守サービス、改造・移設まで一貫した体制でお客様に商品とサービスを提供しています。

永い経験により培った磁性膜形成技術を用いたスパッタリング装置は、ハードディスクの磁気ヘッドおよび磁気ディスク製造用スパッタリング装置では世界トップシェアを有しています。

また同技術を応用し、次世代メモリーSTT-MRAMの量産向け装置を他社に先駆けて発売し、市場で高い評価を受けています。

真空展には毎年継続して出展しており、真空コンポーネント製品中心の展示を行なっています。キャノンアネルバの真空コンポーネント部門は、お客様とより深いリレーションシップを築くために、2013年の販売部門に引き続き2014年には開発部門が同フィールドサービス部門と統合し、フィールドソリューション事業部として活動を展開しています。

「キャノンアネルバは、お客様の最良・最高のパートナーとなります」の事業部方針の下、お客様から様々なお声を頂戴し、販売、サービス、そして製品の質の向上に努めてまいります。